

No	装置番号	施設名称	設置場所	装置分類
1	NPF003	イオンコーター(FIB付帯)(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
2	NPF004	電界放出形走査電子顕微鏡[S4800 FE-SEM]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
3	NPF006	マスクレス露光装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
4	NPF008	スピニングコーター(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
5	NPF009	コンタクトマスクアライナー[MJB4]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
6	NPF010	反転露光用全面UV照射装置	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
7	NPF011	i線露光装置	CR3 イエロールーム	リソグラフィー
8	NPF012	有機ドラフトチャンバー_右(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
9	NPF013	有機ドラフトチャンバー_左(フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
10	NPF014	有機ドラフトチャンバー_右(EB)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
11	NPF015	酸アルカリドラフトチャンバー_右	CR1 クリーンルーム	表面処理
12	NPF016	スターラーウォーターバス[SWB-10L-1]	CR1 クリーンルーム	表面処理
13	NPF017	スマートウォーターバス[TB-1N](フォト)	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
14	NPF018	反応性イオンエッチング装置(RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング
15	NPF019	多目的エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング
16	NPF021	プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理
17	NPF022	UVオゾンクリーナー	CR5 クリーンルーム	表面処理
18	NPF023	電子ビーム真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜
19	NPF024	抵抗加熱型真空蒸着装置	CR1 クリーンルーム	成膜
20	NPF025	スパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜
21	NPF029	メッキ装置	CR1 クリーンルーム	成膜
22	NPF030	プラズマCVD薄膜堆積装置	CR5 クリーンルーム	成膜
23	NPF031	原子層堆積装置_1[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜
24	NPF032	クロスセクションポリリッシャー(ALD付帯)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
25	NPF033	アルゴンミリング装置	CR1 クリーンルーム	エッチング
26	NPF034	集束イオンビーム加工観察装置(FIB)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
27	NPF035	イオンコーター(SEM付帯)(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
28	NPF038	二次イオン質量分析装置(D-SIMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
29	NPF039	オゾンクリーナー(SIMS付属)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
30	NPF041	ウェハー酸化炉	CR1 クリーンルーム	熱処理
31	NPF042	クリーンオープン	CR1 クリーンルーム	熱処理
32	NPF044	マッフル炉	CR1 クリーンルーム	熱処理
33	NPF045	触針式段差計	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
34	NPF046	走査プローブ顕微鏡SPM_1[NanoscopeIV /Dimension3100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
35	NPF047	走査プローブ顕微鏡SPM_2[SPM-9600/9700]	2F 一般実験室	観察・計測・分析
36	NPF048	ナノサーチ顕微鏡SPM_3[SFT-3500]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
37	NPF049	ナノプローバ[N-6000SS]	2F 一般実験室	観察・計測・分析
38	NPF050	四探針プローブ抵抗測定装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
39	NPF051	デバイスパラメータ評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
40	NPF052	デバイス容量評価装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
41	NPF053	ワイヤーボンダー(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
42	NPF054	ダイシングソー	CR4 クリーンルーム	その他
43	NPF055	スクライバー	CR4 クリーンルーム	その他
44	NPF056	研磨機	CR1 クリーンルーム	その他
45	NPF060	短波長レーザー顕微鏡[VK-9700]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
46	NPF061	短波長レーザー顕微鏡[OLS-4100]	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
47	NPF063	分光エリプソメータ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
48	NPF064	解析用PC(分光エリプソメータ用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
49	NPF065	顕微レーザーラマン分光装置(RAMAN)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
50	NPF066	顕微フーリエ変換赤外分光装置(FT-IR)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
51	NPF067	解析用PC(SPM, FT-IR, Raman用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
52	NPF068	磁気特性測定システム(MPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
53	NPF070	X線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
54	NPF072	微小部蛍光X線分析装置	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
55	NPF073	解析用PC(X線用)	2F データ解析室	観察・計測・分析

56	NPF074	X線光電子分光分析装置(XPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
57	NPF075	解析用PC(XPS用)	2F データ解析室	観察・計測・分析
58	NPF081	プラズマCVD薄膜堆積装置(SiN)	CR5 クリーンルーム	成膜
59	NPF082	化合物半導体エッチング装置(ICP-RIE)	CR5 クリーンルーム	エッチング
60	NPF084	デジタルマイクロスコープ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
61	NPF085	物理特性測定装置(PPMS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
62	NPF086	マニュアルウエハプロローバー(2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
63	NPF088	電界放出形走査電子顕微鏡[S4500/FE-SEM](2F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
64	NPF089	赤外線ランプ加熱炉(RTA)	CR1 クリーンルーム	熱処理
65	NPF091	自動塗布現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
66	NPF092	高圧ジェットリフトオフ装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
67	NPF093	高速電子ビーム描画装置(エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
68	NPF094	解析用PC(CAD及び近接効果補正用)	2F データ解析室	リソグラフィー
69	NPF095	RF-DCスパッタ成膜装置(芝浦)	CR1 クリーンルーム	成膜
70	NPF096	単波長エリプソメータ	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
71	NPF098	ECRスパッタ成膜・ミリング装置	CR1 クリーンルーム	成膜
72	NPF099	サムコ原子層堆積装置_2[AD-100LP]	CR5 クリーンルーム	成膜
73	NPF100	解析用PC(L-Edit レイアウト・エディタ)	2F データ解析室	その他
74	NPF101	Si深掘エッチング装置[PlasmaPro_100]	CR5 クリーンルーム	エッチング
75	NPF102	原子層堆積装置_3[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜
76	NPF103	原子層堆積装置_3付帯XPS装置(アルバック・ファイ)	CR5 クリーンルーム	成膜
77	NPF104	原子層堆積装置_4[FlexAL]	CR5 クリーンルーム	成膜
78	NPF105	ピュアオゾン供給装置	CR5 クリーンルーム	成膜
79	NPF106	小型自動現像装置	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
80	NPF107	3次元電界放出形走査電子顕微鏡(エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
81	NPF108	イオンコーター(エリオニクス)	CR1 クリーンルーム	観察・計測・分析
82	NPF109	6インチ電子ビーム真空蒸着装置(アールデック)	CR1 クリーンルーム	成膜
83	NPF110	レーザー描画装置[DWL66+]	CR2 イエロールーム	リソグラフィー
84	NPF111	酸アルカリドラフトチャンバー_左	CR1 クリーンルーム	表面処理
85	NPF112	有機ドラフトチャンバー_左(EB)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
86	NPF113	スピンコーター(EB)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
87	NPF114	平行平板型プラズマアッシャー	CR5 クリーンルーム	表面処理
88	NPF115	大面積電子ビーム描画装置[BODEN50]	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
89	NPF116	EB用自動現像装置(カナメックス)	CR1 クリーンルーム	リソグラフィー
90	NPF117	多機能型薄膜X線回折装置(XRD)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
91	NPF118	多機能型X線光電子分光分析装置(XPS)	2F 一般実験室	観察・計測・分析
92	NPF119	マスクレス露光装置[MLA150]	CR2 クリーンルーム	リソグラフィー
93	NPF120	マスクレス露光装置(DL-2500iA1)	CR2 クリーンルーム	リソグラフィー
94	NPF121	電界放出形走査電子顕微鏡(JSM7400F)	2F 一般実験室	観察・計測・分析